#### 技術資料

Technical Data

# ディープラーニングを用いたNi基超合金におけるSEM

# 写真の相識別

原田絵美\*1,森 大輔\*2

## Phase Classification for Ni-Based Superalloys SEM Images Using

**Deep Learning** 

Emi HARATA and Daisuke MORI

#### **Synopsis**

Ni-based superalloys have excellent high temperature properties due to Ni<sub>3</sub>Al ( $\gamma'$ ) precipitation from matrix ( $\gamma$ ). It is important for material development to measure the amount of  $\gamma'$  precipitation, because it affects the properties greatly. We classify SEM images of Ni-based superalloys into  $\gamma'$  and  $\gamma$  by hand to measure the amount of  $\gamma'$ . However, there is variation in the classification results among operators. In this paper, we automated the classification by image processing and deep learning to eliminate variation. As a result, automation was achieved using ensemble learning of  $\gamma'$  and  $\gamma'\gamma$  boundary, and we became able to measure the amount of  $\gamma'$  regardless of the operator.



Ni 基超合金<sup>1)~5)</sup>は、航空機エンジンや発電設備の タービンブレードに利用されるため、優れた高温強度が 必要となる. Fig. 1 は、Ni 基超合金の走査型電子顕微鏡 (SEM)写真である. Ni 基超合金では、時効処理を施す ことで、Fig. 1 のように母相( $\gamma$ )から Ni<sub>3</sub>Al 相( $\gamma'$ )が 析出する. この $\gamma'$ 析出により、高温強度を発現させる ことができる.

γ′ 析出量の測定は, Ni 基超合金の材料開発において 重要となる.これは, γ′ 析出量が熱処理条件や化学組成 などで変化し,高温強度に大きな影響を与えるためであ る. Fig. 2 は, γ′ 析出率とクリープ破断寿命との関係を 示したグラフである<sup>1)</sup>. クリープ破断寿命はγ′ 析出率の 増加に伴って延び,あるγ′ 析出率でピーク値をとると,



Fig. 1. Microstructure of Ni-based superalloy.

それ以降は短くなる.大同特殊鋼㈱でも Ni 基超合金の 材料開発において, Fig. 2 のような γ 析出率と高温強度 との関係を重視し,研究している.

γ′ 析出率は, SEM 写真から測定することができる<sup>4)</sup>. Fig. 3 は, 作業者が SEM 写真内の γ と γ′ を目視で識別 し, 手動で塗り分けた画像である. この画像から白色部 の面積率を求めることで, γ′ 析出率を測定することがで きる.

2022年10月6日受付

<sup>\* 1</sup> 大同特殊鋼㈱技術開発研究所(Corporate Research & Development Center, Daido Steel Co., Ltd.)

<sup>\* 2</sup> 大同特殊鋼㈱技術開発研究所,技術士(経営工学) (P.E.Jp, Corporate Research & Development Center, Daido Steel Co., Ltd.)



Fig. 2. Relationship between amount of  $\gamma'$  and creep rupture life<sup>1)</sup>.



Fig. 3. Image classified into  $\gamma'$  and  $\gamma$  by manual work.

しかし、この手法で $\gamma'$  析出率を測定すると、作業者の 技量により結果にばらつきが生じる。Fig. 4 は、作業者 A と B の $\gamma'$  識別結果である。A は識別に熟練した作業者 で、B は経験の浅い作業者である。作業者 B は、A に比 べて $\gamma'$  を多く見積もっており、 $\gamma'$  析出率の差は 10 % 以 上となった。Fig. 4 のようなばらつきが生じると、 $\gamma'$  析 出率と高温強度との関係を、正確に解析できないおそれ がある。



Fig. 4. Difference of classification between operator A and operator B.

そこで本稿では,作業者間における γ' 析出率の測定 ばらつきを無くすために,画像処理とディープラーニン グ(以下, DL という)を用いた,γ' 識別の自動化に着 手した.今回は, Fig. 4 の熟練した作業者 A による識別 を正として,開発を進めた.目標精度は,作業者 A が 手動でγ' 識別した画像と,自動でγ' 識別した画像を比 較して,

① γ′ 析出率の差が±5% 以内

② γ′ の Dice 係数が 0.95 以上

とした. ここで, Dice係数<sup>6).7)</sup>は式(1)で算出され, 1 に近いほど画像の一致率が高いことを表す.

$$D = \frac{1 + 2\sum_{i} t_{i} p_{i}}{1 + \sum_{i} t_{i} + \sum_{i} p_{i}}$$
(1)

D: Dice係数 t<sub>i</sub>: 手動で識別した画像の, i番目の画素値 p<sub>i</sub>: 自動で識別した画像の, i番目の画素値 γは画素値 0, γ は画素値 1とする.

目標①と②は、自動での  $\gamma'$ 識別のばらつきが、作業者 Aによる識別のばらつきより小さくなるように設定し た.作業者 Aが同じ SEM写真で  $\gamma'$ 識別を 2回実施し、1 回目と 2回目とを比較することで、作業者 Aのばらつき を測定した.測定には、複数の SEM写真から任意の範 囲(512×512ピクセル  $= 2.4 \times 2.4 \mu m$ )を 4枚切り出し て利用した.作業者 Aのばらつきを 4枚で確認した結果、 1回目と 2回目で  $\gamma'$  析出率の差が最大 5%、Dice係数が 最低 0.95となった.この結果から、目標①と②を決定し た.

### 2. 画像処理の適用

画像処理は,組織写真の解析によく使われる手法であ る.例えば文献 8)では,Al-Cu 合金の鋳造組織写真に フーリエ変換を適用し,デンドライト 2 次アーム間隔や 凝固の進行方向を測定している.また文献 9)では,鉄 鋼の結晶粒写真を二値化し,結晶粒径の分布を測定して いる.

本稿でも、画像処理を用いた γ 識別を試みた. Fig. 5 は、実施した画像処理の手順である.まず、SEM 写真 をぽかすことでホワイトノイズを除去し、コントラスト を調整した.その後、画像の小領域ごとに輝度しきい値 を決めて二値化し、細かい白点や黒点を除去すること で、 γ'を識別した.SEM 写真 14 枚を用い、すべて同じ 条件で処理した.Fig. 6 に、結果の一例を示す.



Fig. 5. Procedure of image processing.





Fig. 6 に示したように、画像処理では目標精度を達成 することができなかった.Fig. 6 では、画像処理で識別 した場合の γ' 析出率が手動で識別した場合より 14.5 % 多くなり、目標①を達成できなかった.Dice 係数も、 目標②を下回っている.これ以外も、14 枚ほとんどの 画像で目標精度を満たせなかった.今回の結果は、γ と γ' の輝度差が小さいことが原因である.Fig. 7 は、Fig. 6 の SEM 写真における各相の輝度分布であり、γ' と γ の 輝度が大きく重なっていることが確認できる.つまり、 輝度のしきい値で二値化すると、γ' を過剰に検出する箇 所や、逆に γ' を見逃す箇所が必ず生じてしまう.また、 すべての写真を同じ条件で処理することは難しい.上記 の理由から、画像処理の適用は困難と判断した.



Fig. 7. Gray level histograms of Fig. 6 SEM image.

## 3. ディープラーニングの適用

### 3. 1 ディープラーニングによるγ'識別

画像処理と同様に、DLも組織写真の解析によく使わ れる手法である。例えば文献10)では、畳み込みニュー ラルネットワーク (Convolutional Neural Network : CNN) を利用し,鉄鋼の組織写真をフェライトやパーライトな どに分類している. 文献 11) では、完全畳み込みネッ トワーク(Fully Convolutional Network: FCN)を利用し, 鉄鋼の組織写真について、マルテンサイトやパーライト などの相を識別している. どちらの文献も, 畳み込み層 をもつモデルを使用している. Fig. 8 は, 畳み込み層の 模式図である.例として、バツ印の画像を入力してい る. 畳み込み層では、画像にフィルタをかけることで、 画像の特徴を抽出した特徴マップを生成している。例え ば、Fig.8のフィルタ1は右下がりの直線を表しており、 入力画像の中で同じ特徴を持つ箇所が、白く表示された 特徴マップを得ることができる. フィルタを複数枚使 用することで、組織写真中の輝度や形状、テクスチャな ど、複数の特徴を考慮できる.

本稿でも Ni 基超合金の SEM 写真に, DL の手法の 1 つであるセマンティックセグメンテーションを適用し, γ' 識別を試みた. セマンティックセグメンテーション は, 文献 11) にも利用されており, Fig. 9 のように, 入 力画像についてピクセル単位でクラスを識別する手法で ある. γ' 析出率を精度良く測定するには, γ' と γ をでき るだけ細かく識別する必要があるため, 本手法を適用し た. また, 学習には入力する組織写真に対応した, 正し い出力(教師データ)を準備する必要がある. 本手法を 適用した場合, 手動で γ' 識別した画像を, そのまま教 師データとして利用できるため, 新たにデータを作成す る手間を省くことができる.



Fig. 8. Schematic diagram of convolution layer.

使用したモデルは、Fig. 10 の、U-Net<sup>7). 12)</sup> をベース としたモデルである.U-Net は、畳み込み層で得られた 特徴マップを、アップサンプリング層で合成、拡大する ことで、識別結果を出力している.また、U-Net では、 畳み込み層とアップサンプリング層を連結している.畳 み込み層における特徴マップの方が、入力画像に近いた め、アップサンプリング層の特徴マップより正確な位置



Fig. 9. Schematic diagram of semantic segmentation.

情報を有している.この位置情報を利用して,アップサンプリングの精度を向上させている.

学習条件を、Table 1 に示す.教師データは、学習デー タとテストデータに分けられる.学習データはモデルの 学習に使用するデータであり、テストデータは学習には 使用せず、学習が終了したモデルに入力して、識別精度 を確認するためのデータである.テストデータには、2 章で使用した 14枚と同じデータを用いた.さらに、学 習データ 10枚から 2枚を選び、検証データとした.学 習は、モデルの出力と教師データとの誤差を示す損失が、 小さくなるように進む.検証データは、学習中に損失の 推移を確認するためのデータである.検証データの損失 が最小となった時点を、学習の終了点とした.入力画像 のサイズについて、学習、検証データは、Fig. 10のよう



Fig. 10. Schematic diagram of model based on U-Net.

に1枚あたり20分割(256×256ピクセル ≒ 1.2×1.2 µm)して使用した.テストデータは分割せず,そのま ま入力した.

今回の学習では、交差検証を実施した.交差検証は、 学習データと検証データの組合せを変えて、複数のモデ ルを作成する手法である.学習データ 10 枚すべてを検 証データとして利用できるように、5 つのモデルを作成 した. Fig. 11 のように、5 つのモデルについて、出力の 平均をとり、二値化した画像を、最終的な出力とした. 交差検証で得られたモデルの平均をとることで、汎化性 能を向上させることができる.

Table 1. Calculation conditions.

Model	Based on U-Net		
Amount of training data	200 (10 x 20-division) Training : Validation = 4 : 1		
Amount of test data	14 (not divided)		
Optimizer	Adam <sup>13)</sup> ( $\alpha = 0.001$ , $\beta_1 = 0.900$ , $\beta_2 = 0.999$ , $\epsilon = 1 \times 10^{-8}$ )		
Loss	Dice loss		
Data augmentation	·Change in gray level (x0.8 ~ 1.1) ·Scaling (x0.8 ~ 1.2) ·Rotation (-20 ~ 20 degrees)		



Fig. 11. Procedure of generating output.

損失関数には,式(2)の Dice 損失関数<sup>6).7)</sup>を使用 した.式(2)が小さくなる,つまり Dice 係数が1に近 づくよう学習した.

$$L = 1 - D = 1 - \frac{1 + 2\sum_{i} t_{i} p_{i}}{1 + \sum_{i} t_{i} + \sum_{i} p_{i}}$$
(2)

L: Dice損失

Fig. 12 は、データ拡張の模式図である.測定対象の SEM 写真では、写真の輝度、サイズ、傾きが変化しう ると考え、この3つのパラメータについて、ランダムに 変更を加え、学習データを水増しした.以上の条件で構 築したモデルの、γ'識別結果を Fig. 13 に示す.Fig. 13 は、Fig. 6 の SEM 写真を識別した結果である.



Fig. 12. Example of data augmentation.



Fig. 13. Comparison between classification results by correct manual work and  $\gamma'$  DL.

### 3. 2 ディープラーニングによる相界面識別

Fig. 6 と Fig. 13 で使用した SEM 写真は,  $\gamma' \geq \gamma$ の輝 度が近いにもかかわらず, 目視で $\gamma'$ を識別できている. これは,  $\gamma' \geq \gamma \geq 0$ 相界面を認識し,  $\gamma'$  識別に利用して いるためだと推定した. Fig. 14 は, SEM 写真の断面模 式図である. 相界面には, 腐食によって段差ができるた め, 影が生じる. この特徴を活用することで,  $\gamma'$ を識別 できると考えた.



Fig. 14. Cross section of etched microstructure.

3. 1節と同様に, Ni 基超合金の SEM 写真にセマン ティックセグメンテーションを適用し, γ' とγの相界面 識別を試みた. 学習データは Fig. 15 のように, 手動で γ' 識別した画像から, 画像処理で相界面のみを抽出して 作成した. 学習は, 3. 1節と同じ条件, モデルで実施 した. Fig. 16 に, 構築したモデルによる相界面の識別 結果を示す. 入力した SEM 写真は, Fig. 6, Fig. 13 と同 じものである.







Fig. 16 のように、相界面を学習したモデルを利用す ることで、3. 1節のモデル (Fig. 13) よりも $\gamma'$ の過剰 な検出を抑制できる可能性がある.相界面を識別できれ ば、Fig. 17(a) のように線の内側を $\gamma'$ とみなし、 $\gamma'$ 析出 率を測定できる.しかし、Fig. 17(b) のように、線の閉じ ていない相界面が存在した.この場合、線の端点がどの 端点と、どのようにつながっているかを、自動で判断す ることは難しい. そのため, このモデルでは γ の領域を 判断できず, γ 析出率を測定できなかった.



Fig. 17. (a) Closed and (b) open boundary on classification result of DL.

4. アンサンブル学習の適用

3章で構築した2つのモデルには、 γ' 識別に得手不得 手がそれぞれ存在する.3.1節のモデル(以下,モデ ルAという)は、 γ' の領域を塗りつぶして出力するた め、 γ' 析出率をそのまま測定できる.しかし、 γ' を過剰 に検出して目標未達となった.一方で3.2節のモデル (以下,モデルBという)は、 γ' の過剰な検出を抑制す ることができた.しかし、相界面が一部開いており、 γ' 析出率を測定できなかった.そこで、両モデルの欠点を 補完する手法を考えた.

3章のモデルについて、アンサンブル学習<sup>14).15)</sup>を適 用することで、Y 識別の精度向上を試みた.アンサンブ ル学習は、複数のモデルを融合することで、単一のモデ ルよりも精度を向上させる手法である.今回は、モデル A とモデル B の出力を、Fig. 18 のように統合した.ま ず、両モデルの出力を重ね合わせ、モデル A が Y' と識 別した各領域について、式(3)の被覆率を算出した. この被覆率が 0.5 以上の場合、モデル A、モデル B と もに Y' と識別したとみなし、Y' として出力した.逆に、 被覆率が 0.5 未満の場合、モデル A が Y' を過剰に検出 しているとみなし、Y に塗り替えて出力した.Fig. 6, Fig. 13 と同じ SEM 写真に適用した結果を、Fig. 19 に示 す.

$$C = \frac{l_{\rm B}}{l_{\rm A}} \tag{3}$$

C: 被覆率

 $l_{A}$ : モデル Aが識別した  $\gamma$  の周長

*l*<sub>B</sub>: モデル Aが識別した γ' に接する, モデルBが識別し た相界面の長さ

Fig. 19 のように、アンサンブル学習では、モデル A



Fig. 18. Combination of outputs from each model.

のみの場合(Fig. 13)よりも、 $\gamma'$ 析出率の測定精度が向上した. つまり、モデルBで出力される相界面の情報 により、モデルAで過剰に検出した $\gamma'$ を修正することができた. Table 2 は、テストデータ 14 枚に各手法を 適用した結果をまとめた表である. 手動で $\gamma'$ 識別した 画像と比較した場合の、① $\gamma'$ 析出率の差(絶対値)、② Dice 係数について、平均値、精度が最良の値、最悪の 値を記載している. Table 2 のとおり、アンサンブル学 習により、すべてのテストデータについて目標精度を達 成することができた.



Fig. 19. Comparison between classification results by correct manual work and ensemble learning.

	Image processing		γ′ DL		Ensemble learning			
	1	2	1	2	1	2		
Mean	8.5	0.893	1.6	0.968	1.3	0.972		
Best	3.7	0.922	0.2	0.985	0.1	0.988		
Worst	14.6	0.858	4.4	0.947	4.4	0.955		

Table 2. Results of each method.

Absolute error of γ' amount %

2 Dice coefficient

本稿では、Ni 基超合金の SEM 写真について,画像処 理と DL を利用し、 γ' 識別の自動化を試みた. Table 2 のとおり、DL を利用することで,識別精度が画像処理 から大きく向上した. さらに、アンサンブル学習によ り、相界面の特徴を考慮することで、目標精度を満たす ことができた. 今回の開発で、手動での γ' 識別が不要 となり、作業者の技量によらない γ' 析出率測定が可能 となった. 実用化へ向けて継続中であり、製品検査への 適用を目指している.

#### (文 献)

- 1) 原田広史,山崎道夫,小泉裕:鉄と鋼,65(1979), 1049.
- Y. Ro, Y. Koizumi and H. Harada: Mater. Sci. Eng. A, 223 (1997), 59.
- T. Murakumo, T. Kobayashi, Y. Koizumi and H. Harada: Acta Mater., 52 (2004), 3737.
- 4) T. M. Smith, P. Bonacuse, J. Sosa, M. Kulis and L. Evans: Mater. Charact., 140(2018), 86.
- 5) F. G. Caballero: Encyclopedia of Materials: Metals and Alloys, Elsevier, 2022, Volume 1, 294.
- F. Milletari, N. Navab and S. -A. Ahmadi: International Conference on 3DV Proc., 4(2016), 565.
- 7)藤田一弥,高原歩:実装ディープラーニング,オーム社,2016,168.
- 8) 舟窪辰也, 新山英輔: 軽金属, 40(1990), 445.
- 9) V. García-García, I. Mejía and F. Reyes-Calderón:

Mater. Charact., 147(2019), 1.

- 10) 足立吉隆, 田口茂樹, 弘川奨悟:鉄と鋼, 102(2016), 722.
- 11) S. M. Azimi, D. Britz, M. Engstler, M. Fritz and F. Mücklich: Sci. Rep., 8(2018), 2128.
- 12) O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox: MICCAI Proc. Part III, 18(2015), 234.
- 13) D. P. Kingma and J. L. Ba: ICLR Proc., 3(2015), Adam: A Method for Stochastic Optimization.
- 14) L. Breiman: Mach. Learn., 24(1996), 123.
- 15) 上田修功: コンピュータビジョンとイメージメディ  $\mathcal{7}$ , 46(2005), 11.





原田絵美

森 大輔